

Faisabilité et croissance avec haute reproductibilité de multicouches métalliques à magnétorésistance géante par pulvérisation diode RF

J. Ben Youssef, H. Le Gall, K. Bouziane, M. El Harfaoui, O. Koshkina, J.

Desvignes, A. Fert

▶ To cite this version:

J. Ben Youssef, H. Le Gall, K. Bouziane, M. El Harfaoui, O. Koshkina, et al.. Faisabilité et croissance avec haute reproductibilité de multicouches métalliques à magnétorésistance géante par pulvérisation diode RF. Journal de Physique IV Proceedings, 1996, 06 (C7), pp.C7-161-C7-166. 10.1051/jp4:1996719 . jpa-00254507

HAL Id: jpa-00254507 https://hal.science/jpa-00254507

Submitted on 4 Feb 2008

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Faisabilité et croissance avec haute reproductibilité de multicouches métalliques à magnétorésistance géante par pulvérisation diode RF

J. Ben Youssef, H. Le Gall, K. Bouziane, M. El Harfaoui*, O. Koshkina, J.M. Desvignes et A. Fert**

CNRS-LMIMS, 92195 Meudon-Bellevue, France * Université Ibn Tofail, Faculté des Sciences, BP. 133, Kenitra, Maroc ** UMR, CNRS-THCSF, 91404 Orsay, France

Résumé: Les objectifs du présent travail sont de deux ordres : d'abord obtenir le rapport de MRG, $\Delta R/R$, le plus élevé dans des multicouches Co/Cu élaborées à partir du procédé inhabituel de pulvérisation par diode radiofréquence (RF). En second, analyser les corrélations entre la MRG d'une part et les textures et rugosités interfaciales déduites des diffractions X aux petits et grands angles et de la microscopie à force atomique (MFA) d'autre part. A cet effet, nous avons cherché à induire différentes structures interfaciales en modifiant les paramètres de pulvérisation (pression du gaz pulvérisant P_{Ar}) ce qui, par ailleurs, a permis de définir les conditions optimales de dépôt pour l'obtention d'une MRG élevée. L'influence de l'épaisseur t_{Co} du film Co a été étudiée pour une épaisseur du film de Cu = 9Å correspondant au premier maximum de la dépendance oscillatoire avec t_{Cu} du rapport de MRG. De ces résultats, nous concluons que le paramètre pertinent est la rugosité interfaciale qui induit un effet important à la fois sur la MRG et sur la résistivité des super-réseaux. Un changement de pente de Rs⁻¹ en fonction de t²_{Co} est attribué à une augmentation de l'effet de rugosité quand t_{Co} décroît de l'échelle mésoscopique (t_{Co}> 25Å).

1. INTRODUCTION

Malgré de nombreux travaux, tant théoriques qu'expérimentaux, publiés récemment pour comprendre l'origine physique de la magnétorésistance géante (MRG) dans les multicouches magnétiques, quelques problèmes ne sont pas complètement résolus comme l'influence de la structure interfaciale pour promouvoir la magnétorésistance (MR). Différentes hypothèses ont été présentées pour expliquer l'origine d'une MRG élevée induite par une rugosité interfaciale soit élevée¹, soit faible². Les super-réseaux Co/Cu, non seulement sont à la base de candidats excellents pour les futurs capteurs magnétiques, mais constituent aussi des structures très intéressantes pour une meilleure compréhension des propriétés de MRG. Les multicouches Co/Cu ont été élaborées jusqu'ici soit par épitaxie par jet moléculaire, par pulvérisation par faisceau d'ions ou, pour la plupart, par pulvérisation DC magnétron. Le but de ce travail est d'une part d'obtenir le plus grand rapport AR/R de MRG pour les multicouches Co/Cu élaborées par le procédé inhabituel de pulvérisation cathodique en mode diode radiofréquence (RF) et d'autre part, d'analyser en détail les corrélations entre la MRG et les textures et rugosités interfaciales, déduites de la diffraction X aux petits et grands angles et de la microscopie à force atomique (MFA). A cet effet, les différentes textures et rugosités d'interface ont été induites en modifiant la pression du gaz pulvérisant (pression d'argon) ce qui, par ailleurs, a permis de définir les conditions optimales de dépôt pour l'obtention d'une magnétorésistance géante.

2. PROCEDURE EXPERIMENTALE

Des super-réseaux $[Co(t_{Co})/Cu(t_{Cu})]_n$ ont été déposés sur des substrats de verre après nettoyage chimique et décapage ionique, avec une couche de base (buffer) de 100Å de Fer et une couche de protection de 12 Å de Co. Les influences de la pression d'argon, P_{Ar} , et des épaisseurs t_{Cu} et t_{Co} des

couches de cuivre et de cobalt, sur la texture, la qualité du super-réseau, la résistance à saturation Rs sous champ de saturation Hs, le rapport de magnétorésistance (Rm-Rs)/Rs où Rm est la résistance maximum à champ nul, la sensibilité de magnétorésistance S et le couplage d'échange J déduit de Hs ont été analysés en détail. t_{C0} , t_{Cu} et t_{Fe} ont été déterminées à partir des vitesses de dépôt calibrées de monocouches épaisses de Co, Cu, et Fe. De plus, le plus grand rapport de MR a été obtenu pour t_{C0} = 11Å et un nombre de périodes Co/Cu égales à n=25.

3. RESULTATS ET DISCUSSION

La figure décrit la variation de magnétorésistance multicouches 1 la des Fe(100Å)/[Co(11Å)/Cu(t_{Cu})]₂₅/Co(12Å) en fonction de l'épaisseur de la couche de Cu pour différentes pressions de dépôt. Pour $P_{Ar} > 1.2 \ 10^{-2}$ mbar, les oscillations de MRG sont bien définies avec une période de 10-12 Å. Pour PAr=5 10-3 mbar, la MRG augmente d'une façon monotone avec l'épaisseur de cuivre. L'absence de la première oscillation de MRG à cette pression peut être attribuée à la présence de trous ou de "ponts" couplant directement les couches de cobalt adjacentes. On note que le maximum de MRG de 43 % a été obtenu, à température ambiante, pour t_{Cu}= 9.5Å et P_{Ar} =2.5 10⁻² mbar. L'épaisseur de chaque couche a été contrôlée avec une très grande précision pendant les dépôts séquentiels de Co et de Cu comme on peut le voir sur le graphique en insertion dans la figure 1(MR en fonction de t_{Cu}), où le premier pic est obtenu pour une épaisseur extrêmement faible de cuivre de 9Å.

Des cycles typiques de MR en fonction du champs, correspondant à 4 échantillons déposés à des pressions d'argon variant de $0.5 \ 10^{-2}$ à 5 10^{-2} mbar, sont représentés sur la figure 2.



Figure 1. MR en fonction de t_{Cu} pour les multicouches Verre/Fe(100A)/[Co(11A)/Cu(t_{Cu})]₂₅/Co(12A) déposées à différentes pressions d'Argon.



Figure 2. Cycles de MR en fonction du champ appliqué pour les multicouches Fe(100A)/[[Co(11A)/Cu(9A)]₂₅ déposées à différentes pressions d'Argon

Le facteur de rectangularité (1-Mr/Ms) des multicouches Fe(100Å)/[Co(11Å)/Cu(t_{Cu})]₂₅/Co(12Å) a été déterminé par magnétométre à échantillon vibrant à partir du cycle d'hystérésis obtenu à température ambiante (Fig.3)

La valeur maximale du rapport de MR, obtenue à $P_{Ar}=2.5 \ 10^{-2}$ mbar, est corrélée à un minimum de résistivité, comme reporté sur la figure 4 et aussi à un maximum du champ de saturation Hs (Fig.5) proportionnel à la fois au couplage d'échange indirect entre les couches adjacentes de Co et au facteur de rectangularité (1-Mr/Ms) qui décrit qualitativement la proportion des régions couplées antiparallèlement dans le film.



Figure 3. Cycle d'hystérésis de l'aimantation de multicouches $Fe(100\text{\AA})/[Co(11\text{\AA})/Cu(9\text{\AA})]_{25}$ déposés à 2.5 10² mbar.



Figure 5. Hs et (1-Mr/Ms) en fonction de P_{ar} pour les multicouches Fe(100Å)/ [Co(11A)/Cu(9A)]₂₅



Figure 4. MR et ρ_s en fonction de P_{Ar} pour les les multicouches Fe(100Å)/[Co(11A)/Cu(9A)]₂₅



Figure 6. Spectres de diffraction X aux grands angles pour pour les multicouches Fe(100Å)/ [Co(11A)/Cu(9A)]₂₅ déposés à différentes pressions d'Argon.

La figure 6 montre les spectres de diffraction X aux grands angles pour les multicouches $[Co(11A)/Cu(9A)]_{25}$ déposées à différentes pressions d'argon. Leur structure cristalline a été étudiée par diffractométrie X (θ -2 θ), en utilisant une anticathode de cuivre à 1.5405 Å. Il est à noter que toutes nos multicouches dont l'épaisseur du cobalt varie de 8 à 62Å sont polycristallines, cristallisant dans une phase cubique à faces centrées (Fig. 7). Cette conclusion diffère de celle obtenue par Shuk⁴ et al et Le Dang⁵ et al qui observent la structure hexagonale compacte (h.c.) du Co pour des épaisseurs supérieures à 40Å. Cette différence est attribuée à des techniques de préparations différentes: suivant les auteurs à savoir rf magnétron⁴, dc magnétron⁵ et rf diode dans notre cas. En effet la différence principale entre les deux techniques: magnétron et diode réside essentiellement dans l'échauffement du substrat. En diode le substrat est soumis à un important flux d'électrons par rapport au magnétron. L'impact de ces électrons très énergétiques sur le substrat provoque une élévation de température important et de là une modification des propriétés cristallines des films minces. Le cobalt présente deux formes cristallines usuelles à savoir h.c stable en dessous de 400°C et c.f.c. au-dessus de cette température, ce qui pourrait expliquer l'absence de la structure hexagonale dans notre cas.

De plus l'orientation des multicouches dépend de la pression de pulvérisation d'argon:

A faible pression ($P_{ar}=0.5\ 10^{-2}\ mbar$), les multicouches sont bien cristallisées avec une orientation préférentielle unique (200). A forte pression (5 $10^{-2}\ mbar$), les multicouches sont faiblement cristallisées avec une texture (220). Aux pressions intermédiaires, où la magnétorésistance est importante, le maximum de MRG peut être corrélé à la présence simultanée des deux raies (200) et (220) d'égales intensités, contrairement aux résultats précédents qui impliquent soit une texture³ (200), soit des textures⁴ (111) et

(200) dans les systèmes Co/Cu élaborés à partir de techniques et dans des conditions de pulvérisation différentes.

Il est connu que le désordre structural dans les films brut de dépôt « as-grown » joue un rôle crucial dans une réaction de l'état solide pour former un alliage amorphe⁶. Les films élaborés à faible pression ne présentent pas de phase amorphe contrairement à ceux déposés à forte pression. Le désordre interfacial aurait pour effet d'activer et de promouvoir le désordre de la phase amorphe. La faible texture (220) observée dans les multicouches Co/Cu déposée à 5 10^{-2} mbar pourrait résulter , en plus des effets déjà cités ci-dessus, d'une désorientation des grains (grande disperssion angulaire entre les différentes cristallites) ce qui a pour conséquence d'induire une structure désordonnée avec nucléation de sites supplémentaires⁶.

L'analyse des spectres de diffraction X en incidence rasante (Fig.8) montre la présence d'un pic de Bragg étroit et d'intensité maximale pour une pression optimale de 2.5 10^{-2} mbar correspondant au maximum de MR. Pour P_{Ar}=0.5 10^{-2} mbar, on remarque l'absence du pic de superstructure. En effet, à faibles pressions, l'énergie cinétique des atomes déposés étant très importante. Ceux-ci peuvent diffuser facilement dans la couche en cours de dépôt et former un mélange Co-Cu à l'interface ce qui peut induire une dégradation de la superstructure.



Figure 7. Spectres de diffraction X aux grands angles des les multicouches $Fe(100\text{ Å})/[Co(11\text{ A})/Cu(t_{Cu})]_{25}$ pour différentes épaisseurs de Co.



Figure 8. Spectre de diffraction X en incidence rasante des multicouches Fe(100Å) $[Co(11A)/Cu(t_{Cu})]_{25}$ élaborés à différentes pressions d'Argon

Les rugosités de surface définies par la valeur quadratique moyenne σ_{rms} de rugosité peuvent être déduites à partir de la largeur du pic de Bragg et par des mesures de microscopie à force atomique (MFA). Ainsi la figure 9 montre que le champ à saturation et le couplage d'échange, l'intensité du pic de Bragg et la magnétorésistance sont maximum lorsque la rugosité d'interface est minimale (σ_{rms} = 3Å).



Figure 9. Variations de MR et de σ_{rms} pour les multicouches Fe(100Å)/[Co(11A)/Cu(9A)]₂₅ en fonction de Par

Nous avons observé par ailleurs, qu'une couche de base de Fe induit le rapport de MRG le plus élevé en comparaison du Ta, Al, Cr, Cu, Co, NiFe (cristallins) ou CoZr, FeZr (amorphes). En effet, des mesures effectuées par MFA montrent que les super-réseaux déposés sans buffer possèdent une rugosité de surface plus importante (σ_{rms} = 17Å et MR= 18%) que celle des films élaborés sur un buffer tel que le Fe par exemple (σ_{rms} = 3Å; MR= 43%), comme illustré sur les figures 10a et 10b. Ceci est associé à une bonne cristallisation de la couche de base qui induit une faible rugosité et de là , une magnétorésistance élevée.



Figures 10. Rugosité observées par MFA : a) sans buffer; b) avec buffer (Fe).

La magnétorésistance est définie à partir du rapport $\Delta R/Rs$ qui dépend de la variation de la résistance ΔR =Rm-Rs due à la différence de diffusion de spin entre des alignements antiparallèle et parallèle des aimantations des couches de Co adjacentes et de la résistance Rs de la multicouche pour un champ appliqué égal ou supérieur au champ de saturation Hs. L'influence sur MR, de la diffusion dans la couche magnétique (massive) peut être analysée à partir de la dépendance de Rs en fonction de l'épaisseur de la couche de cobalt. La figure 11 montre une décroissance de Rs lorsque t_{Co} augmente, ce qui n'est pas le cas de la magnétorésistance qui présente un maximum pour t_{Co} = 11Å. A partir d'un modèle de résistances parallèles incluant les résistances, RCu, RFe, RCo, des couches de Cu, du buffer de Fe et de protection Co, on montre que la conductance totale de la multicouche est décrite par la relation : 1/Rs = A + B. t_{CO}^2 où A est une constante dépendant des couches de base, de protection et de cuivre et B est une valeur dépendant de facteurs géométriques et électriques des couches de cobalt (longueur, libre parcours moyen des électrons et résistivité du cobalt massif). Pour les films "épais", la conductance est décrite usuellement par une fonction linéaire de l'épaisseur. Par contre, pour les films de Co de très faible épaisseur, le libre parcours moyen des électrons, λ_{Co} , est du même ordre de grandeur ou supérieur à l'épaisseur de Co(λ_{Co} > t_{Co}). Dans ce cas la diffusion de surface contribue à la résistivité, entrainant une dépendance quadratique plutôt que linéaire de la résistivité avec tCo. Une telle dépendance quadratique est observée sur la figure 12 pour une épaisseur de Co comprise entre 25 et 70Å. Ce résultat confirme la contribution croissante à la résistivité des processus de diffusion à l'interface lorsque l'épaisseur du film magnétique diminue. Le changement de pente dans la dépendance avec t_{Co}^2 de Rs⁻¹, pour $t_{Co} < 25$ Å, est attribué à une augmentation de l'effet de la rugosité interfaciale induite par la couche de Cobalt quand t_{Co} décroît de l'échelle mésoscopique vers l'échelle nanoscopique.







Figure 12. Variation de la conductance 1/Rs en fonction de t_{Co}^2 des multicouches Fe(100Å) / [Co(t_{Co})/Cu(9A)]_{25}.

L'évolution des propriétés des films en fonction de la pression d'argon est associée au taux de bombardement des échantillons au cours de croissance. Le bombardement par des atomes d'argon très énergétiques favorise la mobilité des atomes à la surface, ce qui entraîne des structures très denses avec des interfaces abruptes. Les mesures de diffraction des rayons-X aux petits angles et les images de AFM indiquent cependant qu'un bombardement excessif, correspondant aux faibles pressions d'argon peut également endommager les muticouches par un accroissement de la rugosité^{7,8}. Inversement une thermalisation des atomes pulvérisés aux pressions d'argon élevées entraine des structures rugueuses et moins denses de part et d'autre de la pression de dépôt optimale. Nous pouvons raisonnablement admettre l'existence d'un couplage mixte AF et F due aux fluctuations d'épaisseur de Co et surtout du cuivre. Cet accroissement des rugosité interfaciale, peut induire à des structures magnétiques décrites en terme de domaines antiphasiques pouvant expliquer en partie la chute de la MRG. De tels types de structure magnétiques comme observé expérimentalement par Rührig et col ⁹ sur des sandwich épitaxiés Fe-Cr-Fe couplés AF.

4. CONCLUSION

Des valeurs élevées de MRG ont été obtenues dans les multicouches Co/Cu élaborées à partir du procédé inhabituel de pulvérisation diode radiofréquence. Des corrélations entre la texture, la rugosité interfaciale dépendant de la pression du gaz pulvérisant et la MRG ont été présentées. De ces résultats, il apparaît qu'une la rugosité interfaciale minimale est requise pour promouvoir une magnétorésistance géante. Par ailleurs l'étude de la variation de MR en fonction de l'épaisseur du Co confirme la contribution croissante à la résistivité des processus de diffusion aux interfaces lorsque l'épaisseur t_{Co} diminue. Les études de réflectivité de neutrons à petits angles en cours pourraient nous renseigner à la fois sur le couplage indirect et le magnétisme des interfaces.

Références

[1] E.E. Fullerton, D.M. Kelly, J. Gimpel et I.K. Schuller, Phys. Rev. Letter, 68 (1992) 859.

- [2] H. Veda et al., Jpn. J. Appl. Phys., 33 (1994) 6173.
- [3] S. Honda, S. Ohmoto, R. Imada et M. Nawate, J. Magn. Magn. Mater., 126 (1993) 419.
- [4] A.M. Shukh, D.H. Shin et H. Hoffman, J. Appl. Phys., 76 (1994) 6507.
- [5] K. Le Dang, P. Veillet, E. Velu, S.S. Parkin and C. Chappert, App. Phys. Lett. 63 (1993) 108.
- [6] B.M. Clemens, J. App. Phys. 61 (1987) 4525.
- [7] Y. Saito, S. Hashimoto, App. Phys. Lett. 60 (1992) 2436.
- [8] S. Honda, S. Ohmoto, R. Imada and M. Nawate, J. Magn. Magn. Mater. 126 (1993) 419.
- [9] M. Rühring, R. Schäfer, A. Hubert, R. Mosler, J.A. Wolf, S. Demorkritov and P. Grunberg, Phys. Status. Solidi (a) 125 (1991) 635.